

Title (en)

Gravimetric moisture analyser

Title (de)

Messgerät zur gravimetrischen Feuchtigkeitsbestimmung

Title (fr)

Dispositif d'analyse gravimétrique de la teneur en humidité

Publication

EP 1912046 A1 20080416 (DE)

Application

EP 06122079 A 20061011

Priority

EP 06122079 A 20061011

Abstract (en)

The measuring device (1) has a measuring chamber (3) partially surrounded by a housing (2). A sample container (9) accommodates sample material, and a weighing machine (18) detects the weight of the sample container. A temperature sensor i.e. infrared temperature sensor (11), is provided with an inlet hole (12) for the detection of infrared radiation, where the inlet hole is directly arranged within a lower outer surface of the sample container. The inlet hole defines a detectable space area of the infrared temperature sensor.

Abstract (de)

Ein Messgerät (1) zur gravimetrischen Feuchtigkeitsbestimmung umfasst einen von einem Gehäuse (2) umgebenen Messraum (3), eine Heizvorrichtung (4), einen Probenbehälter (9) zum Aufnehmen von Probenmaterial und eine Waage (18). Mit der Waage (18) wird das Gewicht des Probenbehälters (9) mit dem Probenmaterial im Messraum (3) erfasst. Zum Erfassen der Temperatur ist mindestens ein Infrarot-Temperatursensor (11) eingesetzt, dessen Eintrittsöffnung (12) direkt unterhalb einer unteren Aussenfläche des im Messraum (3) befindlichen Probenbehälters (9) angeordnet ist. Es gelangt im Wesentlichen nur Infrarot-Strahlung von der Aussenfläche des Probenbehälters (9) in den Infrarot-Temperatursensor. Diese Temperaturmessung erlaubt ein einfaches Erfassen einer äusserst genauen Proben-Temperatur.

IPC 8 full level

G01G 19/00 (2006.01); **G01N 5/02** (2006.01)

CPC (source: EP)

G01G 19/00 (2013.01); **G01N 15/0205** (2013.01)

Citation (search report)

- [XY] US 5983711 A 19991116 - PAPPAS WILLIAM D [US], et al
- [DY] EP 0611956 A1 19940824 - METTLER TOLEDO AG [CH]
- [Y] EP 1195584 A1 20020410 - METTLER TOLEDO GMBH [CH]
- [DA] US 6521876 B2 20030218 - JENNINGS WILLIAM EDWARD [US], et al
- [DA] DE 102005000805 A1 20060713 - MIKROWELLEN SYSTEME MWS GMBH H [CH]

Cited by

DE102012105542A1; DE102012105542B4

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA HR MK RS

DOCDB simple family (publication)

EP 1912046 A1 20080416

DOCDB simple family (application)

EP 06122079 A 20061011